

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成19年10月4日(2007.10.4)

【公表番号】特表2007-522889(P2007-522889A)

【公表日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【年通号数】公開・登録公報2007-031

【出願番号】特願2006-554296(P2006-554296)

【国際特許分類】

**A 6 1 H 7/00 (2006.01)**

【F I】

A 6 1 H 7/00 3 2 2 B

A 6 1 H 7/00 3 2 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月19日(2007.7.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

圧迫処置システムであって：

四肢廻りに支持される第1プラッダ；

前記四肢廻りに支持される第2プラッダであって、前記両プラッダは流体源と流体連通し、前記両プラッダは、前記第1プラッダが第1時間期間膨張し、前記第2プラッダが第2時間期間膨張するように、膨張し、前記第2時間期間は前記第1時間期間内に開始され；および、

膨張可能な前記プラッダから離間して配置した空圧回路であって、前記空圧回路は、コントローラ、単一の圧力センサ、単一のチェック弁、流体源および複数のソレノイド弁を含み；

前記単一の圧力センサは前記流体源と前記ソレノイド弁との間に位置するとともに前記第1プラッダおよび前記第2プラッダに連通し、前記単一のチェック弁は前記流体源に操作可能に接続されて前記流体源とソレノイド弁との間に位置し、前記単一のチェック弁は空気の逆流を防ぎ、前記単一の圧力センサは前記第1プラッダにおける静脈再充満時間の計算のためにプラッダの圧力を測定する；を備える圧迫処置システム。

【請求項2】

前記コントローラは加圧された前記流体源および前記圧力センサと連通し、前記コントローラは前記プラッダの圧力を監視して、調節するように構成される、  
請求項1の圧迫処置システム。

【請求項3】

前記コントローラが、携帯式ハウジングに配置される、  
請求項1の圧迫処置システム。

【請求項4】

前記ハウジングが、複数のプラッダと接続可能な複数のポートを含む、  
請求項1の圧迫処置システム。

【請求項5】

前記圧力センサは前記複数のポート毎に圧力を監視して、プラッダがそこに接続されているかどうかを判定し、前記コントローラにそれを表す信号を送る、

請求項 4 の圧迫処置システム。

【請求項 6】

前記コントローラが、前記複数のプラッダの膨張を調節する別々の弁を含む、

請求項 2 の圧迫処置システム。

【請求項 7】

前記圧力センサは、前記プラッダ毎の圧力を監視するよう構成される、

請求項 1 の圧迫処置システム。

【請求項 8】

前記圧力センサと連通する足プラッダを更に備える、

請求項 1 の圧迫処置システム。

【請求項 9】

圧迫処置システムであって：

四肢廻りに支持される第 1 プラッダ；

前記四肢廻りに支持される第 2 プラッダであって、前記第 1 および第 2 プラッダは流体源と流体連通し、前記第 1 および第 2 プラッダは、前記第 1 プラッダが第 1 時間期間膨張し、前記第 2 プラッダが第 2 時間期間膨張するように、膨張し、前記第 2 時間期間は前記第 1 時間期間内に開始され；

足廻りに支持された第 3 プラッダであって、前記第 3 プラッダは前記流体源と流体連通し；

膨張可能な前記 プラッダから分離して配置した空圧回路であって、前記空圧回路は、コントローラ、单一の圧力センサ、单一のチェック弁、流体源および複数のソレノイド弁を含み、；

前記单一の圧力センサは前記流体源と前記ソレノイド弁との間に位置するとともに前記 プラッダに連通し、前記チェック弁は前記流体源に操作可能に接続されて前記流体源とソレノイド弁との間に位置し、前記单一のチェック弁は空気の逆流を防止し、前記单一の圧力センサは測定対象のプラッダにおける静脈再充満時間の計算のためにプラッダの圧力を測定する；

を備える圧迫処置システム。

【請求項 10】

加圧された前記流体源が、前記四肢廻りに配置した前記プラッダおよび前記足廻りに配置した前記プラッダを交互に膨張させる、

請求項 9 の圧迫処置システム。

【請求項 11】

前記コントローラは加圧された前記流体源および前記单一の圧力センサと連通し、前記コントローラは前記プラッダの圧力を監視して、調節するよう構成される、

請求項 9 の圧迫処置システム。

【請求項 12】

前記コントローラが、携帯式のハウジングに配置される、

請求項 10 の圧迫処置システム。

【請求項 13】

前記コントローラが、前記プラッダの膨張を調節する別々の弁を含む、

請求項 10 の圧迫処置システム。

【請求項 14】

前記单一の圧力センサは、前記プラッダ毎の圧力を監視するよう構成される、

請求項 9 の圧迫処置システム。

【請求項 15】

圧迫処置システムであって：

第 1 の四肢廻りに支持される第 1 の複数のプラッダ；

第 2 の四肢廻りに支持される第 2 の複数のプラッダであって、前記プラッダは流体源と流体連通し、前記プラッダは：

前記第1の複数のプラッダの第1プラッダが第1時間期間膨張し、前記第1の複数のプラッダの第2プラッダが第2時間期間膨張し、前記第2時間期間は前記第1時間期間内に開始され；

前記第2の複数のプラッダの第1プラッダが第3時間期間膨張し、前記第2の複数のプラッダの第2プラッダが第4時間期間膨張し、前記第4時間期間は前記第3時間期間内に開始され；

膨張可能な前記プラッダから離間して配置した空圧回路であって、前記空圧回路は、コントローラ、単一の圧力センサ、単一のチェック弁、流体源および複数のソレノイド弁を含み、；

前記単一の圧力センサは前記流体源と前記ソレノイド弁との間に位置するとともに前記プラッダに連通し、前記チェック弁は前記流体源に操作可能に接続されて前記流体源とソレノイド弁との間に位置し、前記単一のチェック弁は空気の逆流を防ぎ、前記単一の圧力センサは測定対象のプラッダにおける静脈再充満時間の計算のためにプラッダの圧力を測定する；

を備える圧迫処置システム。

#### 【請求項16】

前記コントローラは携帯式ハウジングに配置され、加圧された前記流体源および前記圧力センサと連通し、前記プラッダの圧力を監視して、調節するよう構成される、

請求項15の圧迫処置システム。

#### 【請求項17】

前記加圧流体源が、前記第1の四肢廻りに配置した前記プラッダおよび前記第2の四肢廻りに配置した前記プラッダを交互に膨張させる、

請求項15の圧迫処置システム。

#### 【請求項18】

圧迫処置システムであって：

第1の四肢廻りに支持される第1の複数のプラッダ、および第2の四肢廻りに支持される第2の複数のプラッダ；

前記第1の複数のプラッダおよび前記第2の複数のプラッダの各プラッダは、それらと連通する別々の弁を有し、前記弁は流体源と流体連通し、前記プラッダは：

前記第1の複数のプラッダの第1プラッダが第1時間期間膨張するように第1弁が開き、前記第1の複数のプラッダの第2プラッダが第2時間期間膨張するように第2弁が開き、前記第2時間期間は前記第1時間期間内に開始され、前記第1の複数のプラッダの第3プラッダが第3時間期間膨張するように第3弁が開き、前記第3時間期間は前記第2時間期間内に開始される；とともに、

前記第2の複数のプラッダの第1プラッダが第4時間期間膨張するように第4弁が開き、前記第2の複数のプラッダの第2プラッダが第5時間期間膨張するように第5弁が開き、前記第5時間期間は前記第4時間期間内に開始され、前記第2の複数のプラッダの第6プラッダが第6時間期間膨張するように第6弁が開き、前記第6時間期間は前記第5時間期間内に開始される；よう膨張し；

膨張可能な前記プラッダから離間して配置した空圧回路であって、前記空圧回路は、コントローラ、単一の圧力センサ、単一のチェック弁、流体源および複数のソレノイド弁を含み、；

前記コントローラは加圧された前記流体源および前記圧力センサと連通し、前記コントローラは前記プラッダの圧力を監視して、調節するよう構成され、

前記単一の圧力センサは、前記流体源と前記ソレノイド弁との間に位置するとともに前記プラッダに連通し、前記チェック弁は前記流体源に操作可能に接続されて前記流体源とソレノイド弁との間に位置し、前記単一のチェック弁は逆流を防止し、前記単一の圧力センサは測定対象のプラッダにおける静脈再充満時間の計算のためにプラッダの圧力を測定する；

を備える圧迫処置システム。

**【請求項 19】**

前記チェック弁は、電気信号を前記コントローラに出力することなしに操作する、  
請求項 1、9、15、18 の圧迫処置システム。

**【請求項 20】**

前記測定対象のプラッダは、前記第1の複数のプラッダの第1プラッダ、前記第1の複数のプラッダの第2プラッダ、前記第2の複数のプラッダの第1プラッダおよび前記第2の複数のプラッダの第2プラッダからなるグループから選択される、請求項15の圧迫処置システム。